

شرکت (دانش بنیان تولیدی)
توسعه فناوری ریز مقیاس آژینه



Semi Auto lithography Rack
ALR-365

یونیت یکپارچه فرایند لیتوگرافی بدون سیستم انطباق از دو بخش مجزا تشکیل شده است که این دو بخش در یک محفظه ایزوله شده با محیط بیرون فرایند لیتوگرافی را از ابتدا اجرا می کند. این فرایند شامل چند مرحله از جمله اسپین، پخت رزیست، نوردهی و بازپخت است.

❖ قابل استفاده برای ساخت ادوات MEMS، میکروفلوئیدیک، برخی سنسورها و کاربردهای مرتبط با نانو.

❖ اجرای یک یا چند مرحله از مراحل اسپین، پیش پخت، باز پخت و نوردهی

❖ ایجاد الگوها با دقت چند میکرون روی بسترهای تخت

❖ مجهز به سامانه نگهدارنده ماسک و نمونه با استفاده از خلا در اندازه‌های مختلف

❖ مجهز به سامانه Load / Unload کردن نمونه و ماسک به صورت برقی

❖ رزولوشن بالا به علت منبع تکفام و کاملاً یکنواخت

❖ انجام فرایند با فتورزیست‌های مثبت و منفی

❖ امکان اتوماتیک کردن دستگاه جهت تولید انبوه نمونه‌های استاندارد